

処分予定財産需要調査一覧表

事業名：希少金属代替材料開発<透明電極向けITO代替材料開発（スパッタ製膜InフリーZnO系透明導電膜のLCD用透明電極への適合化技術の開発）>

NO	区分	財産名	仕様又は 号 型式番	数量	取得日	保管又は設置場所	備 考
1	(イ)	恒温恒湿器	東京理化工機製 KCL-2000A	2台	2008/1/18	石川県野々市市扇が丘7-1 金沢工業大学光電相互変換デバイスシステム研究開発センター	継続使用：可 但し、汚れや傷がある。 傷：有 特記事項：
2	(イ)	手動5槽式超音波洗浄装置	CREST社製 OJ5-150M520-WRRRD	1台	2008/2/15	石川県野々市市扇が丘7-1 金沢工業大学光電相互変換デバイスシステム研究開発センター	継続使用：可 傷：有 特記事項： 搬出費用として、設置場所の館内ドア一時取り外し等工事費が発生する。
3	(イ)	複合分子ポンプ	大阪真空機器製作所製 TG2400FCAB	1個	2008/2/22	石川県野々市市扇が丘7-1 金沢工業大学光電相互変換デバイスシステム研究開発センター	継続使用：可 但し、インターバック式スパッタ装置に組み込まれており、単体では使用できない。 傷：無 特記事項：
4	(イ)	手動式ゲートバルブ	大阪真空機器製作所製 VAT-10848-CE01	1個	2008/2/22	石川県野々市市扇が丘7-1 金沢工業大学光電相互変換デバイスシステム研究開発センター	継続使用：可 但し、インターバック式スパッタ装置に組み込まれており、単体では使用できない。 傷：無 特記事項：
5	(イ)	薄板ガラス切断機	アルメックホンゴ製 AL629	1台	2008/3/11	石川県野々市市扇が丘7-1 金沢工業大学光電相互変換デバイスシステム研究開発センター	継続使用：可 傷：有 特記事項： 搬出費用として、設置場所の館内ドアの一時取り外し等工事費が発生する。
6	(イ)	インターバック式スパッタ装置	ULVAC製 SIH-300RD特型	1式	2008/3/17	石川県野々市市扇が丘7-1 金沢工業大学光電相互変換デバイスシステム研究開発センター	継続使用：可 特型仕様であり、複合分子ポンプや手動式ゲートバルブを取り除く場合は、メクラフランジで蓋をする等の措置及び調整を別途行わないと使用できない。 傷：有 特記事項： 装置のサイズが大きい（所要設置床面積約W4000×D3500×H2500mm）ため完成形での搬出が不可能。設置場所から搬出するには、専門業者に装置の分解並びに搬出後の再組立作業と調整を別途依頼する必要がある。

1. 区分は、(ア)事務用備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、図書類、(エ)無体財産権（産業財産権等）、(オ)その他の物件（不動産及びその従物）とする。
2. 規格は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載している。
3. 保管場所は、現在の財産の保管場所及び住所を記載している。
4. 備考は、財産の状態（継続使用の可否・傷の有無・特記すべき事項）を記載している。